



sistemas de deposição para semicondutores compostos

Chuveiro acoplado fechado® 3 x 2 polegadas ÷ 6 x 2 polegadas

AIXTRON

Our technology. Your future.

Chuveiro acoplado fechado® 3x2 polegadas · 6x2 polegadas

Visão geral do produto

- ▶ Chuveiro de acoplamento fechado comprovado®
 - Verdadeira escalabilidade da P&D para a produção em massa
 - Crescimento inerentemente uniforme e reproduzível para todos os sistemas de materiais – concentre seus esforços no desenvolvimento de materiais e dispositivos
 - Alta flexibilidade na janela de processo para excelente qualidade e uniformidade do material Ideal para pequenos
- ▶ orçamentos de P&D: menor custo operacional
 - Baixo fluxo de gás e alta eficiência de precursor
 - Manutenção fácil e de baixo custo
- ▶ Aplicações disponíveis - GaN, InP, GaAs, InSb, GaInNAs, II-VI, para outras, fale conosco!
- ▶ Configurações disponíveis
 - 3 x 2 polegadas, 1 x 4 polegadas, 1 x 3 polegadas, 1 x 2 polegadas – por troca simples de transportadora - 6 x 2 polegadas, 3 x 3 polegadas, 1 x 6 polegadas – por troca simples de transportadora
- ▶ Inúmeras referências de clientes no mundo todo!

Características

- ▶ Aquecedor confiável de 3 zonas
- ▶ Alta flexibilidade para fontes opcionais de MO e hidreto
- ▶ Controladores digitais de fluxo de massa e controladores de pressão
- ▶ Sistema de controle avançado profissional AixAct® com interface gráfica baseada em HTML
- ▶ Pegada compacta

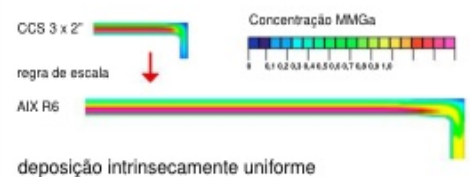
Opcional

- ▶ Ajuste dinâmico da lacuna do processo – ajuste eficaz do processo para maior desempenho Kit de temperatura de superfície de 1300 °C
- ▶ Portfólio versátil de monitoramento in-situ: Laytec EpiTT, EpiCurveTT, muitos outros mediante solicitação
- ▶ Dispositivo de mapeamento térmico AIXTRON ARGUS
- ▶ Sensores de concentração de gás Epison da AIXTRON para maior precisão da injeção de precursores

Reator CCS Flip Top (3 x 2 polegadas · 6 x 2 polegadas)



CCS típico: escala real



MEMORIAL DESCRITIVO / CATÁLOGO TÉCNICO

Reator CCS Flip Top – Sistema MOCVD para P&D e produção em pequena escala

Fabricante: AIXTRON SE

Produto: Reator CCS Flip Top com Chuveiro de Acoplamento Fechado (CCS)

Configurações: 3 × 2 polegadas e 6 × 2 polegadas

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sistema MOCVD destinado à deposição de materiais para semicondutores compostos, com Chuveiro de Acoplamento Fechado (CCS). O sistema apresenta configuração para pesquisa e desenvolvimento e produção em pequena escala, com possibilidade de diferentes configurações de suporte de substratos.

2. CARACTERÍSTICAS E RECURSOS

- Chuveiro de acoplamento fechado comprovado (CCS).
- Aquecedor de 3 zonas.
- Alta flexibilidade para fontes opcionais de MO e hidreto.
- Controladores digitais de fluxo de massa e controladores de pressão.
- Sistema de controle avançado AixAct® com interface gráfica baseada em HTML.
- Pegada compacta.
- Baixo fluxo de gás e alta eficiência de precursor.
- Alta flexibilidade na janela de processo para qualidade e uniformidade do material.
- Manutenção de baixo custo.
- Crescimento uniforme e reproduzível para diferentes sistemas de materiais.

3. APLICAÇÕES

Aplicações indicadas para materiais e processos envolvendo GaN, InP, GaAs, InSb, GaInNAs e materiais dos grupos II-VI, conforme configuração do sistema.

4. CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- 3 × 2 polegadas; 1 × 4 polegada; 1 × 3 polegada; 1 × 2 polegadas, por troca de transportadora.
- 6 × 2 polegadas; 3 × 3 polegadas; 1 × 6 polegada, por troca de transportadora.

5. OPÇÕES / MONITORAMENTO IN-SITU

- Ajuste dinâmico da lacuna do processo.
- Kit de temperatura de superfície de até 1300 °C.
- Portfólio de monitoramento in-situ, incluindo Laytec EpiTT e EpiCurveTT.
- Dispositivo de mapeamento térmico AIXTRON ARGUS.
- Sensores de concentração de gás EpiSon para maior precisão na injeção de precursores.

6. IMAGEM DO EQUIPAMENTO

Sistemas MOCVD para P&D e produção em pequena escala

Chuveiro acoplado fechado® 3x2 polegadas · 6x2 polegadas

Visão geral do produto

- ▶ Chuveiro de acoplamento fechado comprovado®
 - Verdadeira escalabilidade da P&D para a produção em massa
 - Crescimento inerentemente uniforme e reproduzível para todos os sistemas de materiais – concentre seus esforços no desenvolvimento de materiais e dispositivos
 - Alta flexibilidade na janela de processo para excelente qualidade e uniformidade do material Ideal para pequenos
- ▶ orçamentos de P&D: menor custo operacional
 - Baixo fluxo de gás e alta eficiência de precursor
 - Manutenção fácil e de baixo custo
- ▶ Aplicações disponíveis - GaN,
InP, GaAs, InSb, GaInNAs, II-VI, para outras, fale conosco!
- ▶ Configurações disponíveis
 - 3 x 2 polegadas, 1 x 4 polegadas, 1 x 3 polegadas, 1 x 2 polegadas – por troca simples de transportadora - 6 x 2 polegadas, 3 x 3 polegadas, 1 x 6 polegadas – por troca simples de transportadora
- ▶ Inúmeras referências de clientes no mundo todo!

Características

- ▶ Aquecedor confiável de 3 zonas
- ▶ Alta flexibilidade para fontes opcionais de MO e hidreto
- ▶ Controladores digitais de fluxo de massa e controladores de pressão
- ▶ Sistema de controle avançado profissional AixAct® com interface gráfica baseada em HTML
- ▶ Pegada compacta

Opcional

- ▶ Ajuste dinâmico da lacuna do processo – ajuste eficaz do processo para maior desempenho Kit de temperatura de superfície
- ▶ de 1300 °C
- ▶ Portfólio versátil de monitoramento in-situ: Laytec EpiTT, EpiCurveTT, muitos outros mediante solicitação
- ▶ Dispositivo de mapeamento térmico AIXTRON ARGUS
- ▶ Sensores de concentração de gás Epison da AIXTRON para maior precisão da injeção de precursores

Reator CCS Flip Top (3 x 2 polegadas · 6 x 2 polegadas)



AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Alemanha

TELEFONE +49 (2407) 9030-0 fax +49 (2407) 9030-40

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com

AIXTRON
Our technology. Your future.

Documento técnico elaborado exclusivamente com as características técnicas constantes do catálogo fornecido. Não contém identificação de importador/exportador, número de LPCO, DUIMP, invoice, pedido de compra, número de série ou ano de fabricação do equipamento.